



流量計, その他

④ エクセレント・マークIIシリーズ 付属パーツ構成表

ご注文要領...本体・出入口Rc1/4に対応いたします。

下記の要領で、ご注文下さい。

認定 型式 グレード P1計 P2計 入口継手 出口継手 バルブ 逃し弁 パネル取付

- EX - - - - - - - - -

認定

MR	無記入
認定品	非認定品

— 認定品仕様 —
MRシリーズ
御注文時に下記項目をご指定下さい

型 式	流体名
右高圧 / 左高圧	
1次 / 2次設計圧力	
1次 / 2次圧力計	
入口 / 出口継手形状	

型式

記 号
20mkII
100mkII
300mkII
400mkII
500mkII
600mkII

グレード

記 号	形 状
G2	接続部全てネジ込み構造
G3	接続部全てネジ込み構造

P1計/P2計

記 号	圧力レンジ
35	0~35MPa
25	0~25MPa
16	0~16MPa
10	0~10MPa
6	0~6MPa
4	0~4MPa
2.5	0~2.5MPa
1.6	0~1.6MPa
1	0~1MPa
1.6C	-0.1~1.6MPa連成計
1C	-0.1~1MPa連成計
0.6C	-0.1~0.6MPa連成計
0.4C	-0.1~0.4MPa連成計
0.25C	-0.1~0.25MPa連成計
0.1C	-0.1~0.1MPa連成計
N	圧力計ナシ・開放
P	圧力計ナシ・開放プラグ止め
各記号	各種継手
詳細記入	その他 (圧力計エルボ付等)

記 号	圧力計/本体接続
G2	R1/4 / Rc1/4
G3	R1/4 / Rc1/4

逃し弁

記 号	形 状
A	R1/4
A1	φ6ホース ジョイント付
A2	φ6.35メス コネクター付
N	プラグ止め
詳細記入	その他

パネル取付

記 号	形 状
PM	付
N	なし

バルブ

記 号	V1	V2	V3	V4	V0
構 成	出口弁(ダイヤフラム弁)	出口弁(ディスク弁)	入口パージ弁+逆止弁	入口パージ弁+入口弁+逆止弁	
形 状					バルブなし

I 一般工業ガス用
圧力調整器

II 分析用標準ガス・
理科学機器用
圧力調整器

III 半導体用特殊材料ガス・
高純度・超高純度
キャリアガス用圧力調整器

IV 一般工業ガス
供給設備・機器

V 分析用標準ガス
供給設備・機器

VI 半導体用特殊材料ガス
高純度・超高純度
キャリアガス供給設備・機器

VII 大臣認定について

VIII 高圧ガス法律

IX 参考資料

2圧縮リング継手は、指定のない限り、Swagelok社製Swagelok継手とします。

入口継手/出口継手

	記号	形 状	G2,G3
2圧縮リング継手 (インチ・サイズ) Swagelok 又は Finelok	U1	φ3.18 オスコネクター	○
	U2	φ6.35 オスコネクター	○
	U3	φ9.53 オスコネクター	○
	U4	φ12.7 オスコネクター	○
	UL1	φ3.18 オスエルボ	○
	UL2	φ6.35 オスエルボ	○
	UL3	φ9.53 オスエルボ	○
	UL4	φ12.7 オスエルボ	○
	T1	φ3.18(チューブ) オスアダプター	○
	T2	φ6.35(チューブ) オスアダプター	○
	T3	φ9.53(チューブ) オスアダプター	○
	T4	φ12.7(チューブ) オスアダプター	○
	2圧縮リング継手 (ミリ・サイズ) Swagelok 又は Finelok	Um3	φ3 オスコネクター
Um4		φ4 オスコネクター	○
Um6		φ6 オスコネクター	○
Um8		φ8 オスコネクター	○
Um10		φ10 オスコネクター	○
Um12		φ12 オスコネクター	○
ULm3		φ3 オスエルボ	○
ULm4		φ4 オスエルボ	○
ULm6		φ6 オスエルボ	○
ULm8		φ8 オスエルボ	○
ULm10		φ10 オスエルボ	○
ULm12		φ12 オスエルボ	○
容器接続継手	R2	W22山14右 足ネジセット	○
	L1	φ21山14左 足ネジセット	○
	L2	W22山14左 足ネジセット	○
	R6	W26山14右 足ネジセット	○
	L6	W26山14左 足ネジセット	○
	R7	W27山P2.0右 足ネジセット	○
そ の 他	H6	ホース継手 φ6 R1/4	○
	H8	ホース継手 φ8 R1/4	○
	N 詳細	接続継手なし その他(フランジ等、特殊継手)	

I 一般工業ガス用
圧力調整器

II 分析用標準ガス、
理科学機器用
圧力調整器

III 半導体用特殊材料ガス
高純度・超高純度
キャリアガス用圧力調整器

IV 一般工業ガス
供給設備・機器

V 分析用標準ガス
供給設備・機器

VI 半導体用特殊材料ガス
高純度・超高純度
キャリアガス供給設備・機器

VII 大臣認定について

VIII 高圧ガスの法律

IX 参考資料